

## 分析計測センター 機器利用料金表 (令和5年度)

学内用

(円/時間)

機器名	型番 メーカー	通常料金 (自己測定)	時間外料金 (×1.5)	依頼・講習 (×2)
<b>FE-EPMA</b> フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ	<b>JXA-i HP-200F</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>GD-OES</b> グロー放電発光分光分析装置	<b>GD-Profiler2</b> Horiba	1,500	2,250	3,000
<b>Nexsa</b> 全自動X線光電子分光装置	<b>Nexsa</b> Thermo Fisher Scientific	2,000	3,000	4,000
<b>XPS</b> X線光電子分光装置	<b>JPS-9010TR</b> JEOL	700	1,050	1,400
<b>AES</b> オージェ電子分光装置	<b>JAMP-9500F</b> JEOL	1,500	2,250	3,000
<b>FT-IR</b> フーリエ変換赤外分光装置	<b>FT/IR-4100</b> JASCO	400	600	800
<b>LRS</b> レーザーラマン分光装置	<b>NRS-7200</b> JASCO	700	1,050	1,400
<b>UV-Vis/NIR</b> 紫外可視近赤外分光光度計	<b>V-770</b> JASCO	400	600	800
<b>FL</b> 分光蛍光光度計	<b>FP-8550</b> JASCO	400	600	800
<b>ESR</b> 電子スピン共鳴分光装置	<b>JES-RE2X</b> JEOL	200	300	400
<b>Powder-XRD</b> 粉末X線回折装置	<b>SmartLab 3kW</b> Rigaku	700	1,050	1,400
<b>Inplane-XRD</b> In-plane型X線回折装置	<b>SmartLab 9kW</b> Rigaku	800	1,200	1,600
<b>Low temperature XRD</b> 低温X線回折装置	<b>SmartLab 9kW</b> Rigaku	800	1,200	1,600
<b>XRF</b> 蛍光X線分析装置	<b>ZSX-Primus II</b> Rigaku	700	1,050	1,400
<b>XRF</b> 蛍光X線分析装置	<b>ZSX-Primus III+</b> Rigaku	700	1,050	1,400
<b>TEM</b> 透過型電子顕微鏡	<b>HT7700</b> Hitachi	2,000	3,000	4,000
<b>FE-TEM</b> 電界放出型透過電子顕微鏡	<b>JEM-2100F</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>FE-SEM</b> 電界放出形走査電子顕微鏡	<b>SU8230</b> Hitachi	2,000	3,000	4,000
<b>FE-SEM</b> 電界放出形走査電子顕微鏡	<b>SU8000</b> Hitachi	1,000	1,500	2,000
<b>Schottky FE-SEM</b> ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡	<b>JSM-IT800</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>Flex-SEM</b> 走査電子顕微鏡	<b>Flex-SEM 1000 II</b> Hitachi	800	1,200	1,600

分析計測センター 機器利用料金表 (令和5年度)

学内用

機器名	型番 メーカー	通常料金 (自己測定)	時間外料金 (×1.5)	依頼・講習 (×2)
cryo-SEM cryo走査電子顕微鏡	JSM-IT200 JEOL	通常ステージ		
		800	1,200	1,600
		クールステージ		
卓上SEM(日立) 卓上走査電子顕微鏡	TM3030Plus Hitachi	500	750	1,000
		クールステージ		
Benchtop-SEM(JEOL) 卓上走査電子顕微鏡	JCM-6000Plus JEOL	600	900	1,200
FIB-FESEM(JEOL) 複合ビーム加工観察装置	JIB-4700F JEOL	2,500	3,750	5,000
FIB(日立) 集束イオンビーム加工観察装置	FB2200 Hitachi	2,500	3,750	5,000
ION MILLING イオンミリング	IM4000Plus Hitachi	500	750	1,000
		断面ミリングの場合 加工CP 1回につき		
Ultramicrotome ウルトラマイクロトーム	EM UC7 Leica	800	1,200	ご相談 ください
SEM MILL SEM用イオンミリング装置	MODEL1061 Fischione Instruments	500	750	1,000
熱分解GC-TOF/MS 熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	JMS-T200GCx-plus JEOL	800	1,200	1,600
ICP-OES ICP発光分光分析装置	ICPE-9820 SHIMADZU	1,500	2,250	3,000
AA 原子吸光分光光度計	AA-7000 SHIMADZU	600	900	1,200
イオン化エネルギー測定装置	BIP-KV100J BUNKOUKEIKI	800	1,200	1,600
X線CT 高分解能3次元X線CTシステム	SkyScan1172 Burker	2,000	3,000	4,000
CSI ナノ3D光干渉計測システム	VS1800 Hitachi	500	750	1,000
DLS 粒度分布/ゼータ電位計	ZETASIZER Pro Malvern Panalytical	400	600	800
SPM 走査プローブ顕微鏡	E-sweep Hitachi	400	600	800
Plasma Coater (Os) オスミウムコーター	Tennant20 Meiwafosis	※ ワンショットあたり 200		
CR クリーンルーム		300	450	600

- ・ 時間外料金は平日9:00~17:00以外の利用に適用されます
- ・ 上記の他に1時間あたり150円の電気料が加算されます
- ・ 卓上SEM(日立)は物材分野の教職員・学生は課金対象外です(電気代のみ請求)